

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】平成 17 年 5 月 26 日 (2005.5.26)

【公開番号】特開 2002-134490 (P2002-134490A)  
【公開日】平成 14 年 5 月 10 日 (2002.5.10)  
【出願番号】特願 2001-315399 (P2001-315399)  
【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/31  
C 2 3 C 16/44  
H 0 1 L 21/3065

【F I】

H 0 1 L	21/31	C
C 2 3 C	16/44	J
H 0 1 L	21/302	N

【手続補正書】  
【提出日】平成 16 年 7 月 26 日 (2004.7.26)  
【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】請求項 16  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【請求項 16】

前記洗浄ガス供給器及び蒸着ガス供給器は、各々、  
ガスを供給するためのガス供給部と、  
前記ガス供給部で供給されるガスを前記チャンバ内に供給するためのガス供給ラインと

、  
前記ガス供給部と前記ガス供給ラインとの間の連結地点に設けられ前記供給されるガスを制御するための切換バルブとを含むことを特徴とする請求項 15 に記載の化学気相蒸着装置。